



## レーザー協会第 171 回研究会 レーザー加工光学系の今

**【趣旨】** レーザ加工分野では、レーザー装置のみならず、光学素子およびそれらの作製技術や計測技術といった周辺要素も着実な進歩を遂げ、高機能化・高精度化に大きく寄与しています。今回はこのような加工光学系に焦点を当て、先端的な技術や製品を扱っている企業からその一端を紹介していただきます。

**【日時】** 2015 年 1 月 23 日(金) 13:20 ~ 16:50

**【会場】** 中央大学 後楽園キャンパス 6 号館 4 階 6417 号室

〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27

アクセスについては <http://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/> をご参照ください

### 【プログラム】

13:20~13:30 開会挨拶

レーザー協会会長 新井 武二

13:30~14:10 「インプロセスでのレーザー溶接溶け込み深さ計測技術」

プレシテック・ジャパン株式会社 門屋 輝慶 氏

材料加工としてレーザーが採用されているが、品質保証に対する要求はますます厳しくなっている。今日までのいかなるモニタリングシステムでも、溶接部の溶け込み深さやキーホールの深さを実測できない。In-process depth meter は、レーザー溶接中のキーホールの深さを実測できる技術である。

14:10~14:50 「レーザー性能を活かす光学素子」

株式会社オプトライン 中村 洋介 氏

レーザーは、レーザーヘッドから照射部の間に使用される光学素子に大きな影響を受ける。使用する光学素子を一つ一つ見直すことで、レーザー本来の性能を活かした光学系を作ることが可能である。講演では、主に我々の取り扱っているレーザーに特化した光学素子（ミラーや光学フィルター等）をご紹介します。

14:50~15:10 休憩

15:10~15:50 「熱レンズ効果解消光学系ならびに高出力レーザー用イオンビームスパッタコーティングの紹介」

オーテックス株式会社 山本 宏 氏

高出力レーザー光学系に関して、熱レンズ効果による焦点の変動の解消法と、光学素子表面に施すコーティングの高耐力化を取り上げる。前者はレンズ素材の特徴を反映した光学系の事例について、また後者はイオンビームによるスパッタリングを用いた光学コーティング技術について、既存のコーティング技術の比較および実測データを含めて紹介する。

15:50~16:30 「II-VI 社における光学部品のご紹介」

ツーシックスジャパン株式会社 諏訪 隆久 氏

II-VI 社では紫外から赤外にわたる光学部品の提供を可能としております。最近でファイバーレーザー用光学部品の需要や、お客様の御要望に合わせた光学設計も増えております。今回は、II-VI 社とそれらの光学部品のご紹介をさせていただきます。

16:45～16:50 質疑応答

16:45～16:50 閉会挨拶

【参加費】 会員:無料 非会員:4,000 円 (当日お支払いください)

【申込締切】 2015 年 1 月 19 日(月)

【問合せ先】 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 庄司 一郎

〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27 Tel: 03-3817-1867 / Fax: 03-3817-1847

E-mail: [ishoji@elect.chuo-u.ac.jp](mailto:ishoji@elect.chuo-u.ac.jp)

---

### 第 171 回レーザー協会研究会 参加申込

下記事項を記入し FAX でお申込みいただくか、レーザー協会ウェブページ <http://jslt.jp/> よりご登録ください。

Fax: 03-3817-1847 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 庄司 一郎 宛

フリガナ	当協会における会員種別 (○で囲んでください)
ご氏名 :	法人会員      個人会員      非会員
ご所属 :	参加人数 :                      人
連絡先 : 〒	
Tel:	Fax:
E-mail:	